

國立交通大學 工學院專班半導體材料與製程設備學程 93 學年度第 一 學期課程表

當學 期課 號	永久 課號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
		中 文	英 文 (有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
5329	ISR 5601	半導體製造技術導論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	張 翼 T8802			IJK EE210			
5330	ISR 5602	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	陳家富 T6924				IJK EE210		
5331	ISR 5603	半導體製程設備概論	Introduction to Semiconductor Equipment	選	3	3	成維華 T7844		IJK EE210				
5332	ISR 5604	電子與光電材料	Electronic and Optoelectronic Materials	選	3	3	吳耀銓 T8825					IJK EE210	
5334	ISR 5606	材料科學與工程導論	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	陳智 T8925	IJK EE210					
5333	ISR 5605	半導體產業經濟及管理導論	Introduction to Semiconductor Industry of Economy and Management	必	3	3	杜家慶 PTC05 林錫銘 PTC56 林健正 T8055						BCD EE324

國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所)93 學年度第二學期課程計畫表

永久 課號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文 (有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISR 5136	半導體設備監控	Monitoring and Control of Semiconductor Manufacturing Equipment	選	3	3	游輝祥 PTB17	IJK EE210					
ISR 5138	半導體材料分析	Materials Characterization for Semiconductors.	選	3	3	張立 T8627 潘扶民 T9241			IJK EF205			
ISR 5139	半導體微影、清洗、檢測 技術與設備	Semiconductor Technology and Equipment in Photolithography, Cleaning and Inspection.	選	3	3	成維華 T7844					IJK EE210	
ISR 5148	封裝技術與設備	Packaging technology and equipment.	選	3	3	陳仁浩 T8505				IJK EE210		
ISE 5002	半導體製程與工業安全	Semiconductor Fabrication and Industrial Safety.	選	3	3	張翼 T8802				IJK EE232		
ISE 5003	奈米結構材料及其製程技 術	The nanostructured materials and their fabrication techniques.	選	3	3	郭正次 T6707	IJK EF207					
ISE 5004	實驗設計	Design of Experiment	選	3	3	唐麗英 T8074		IJK MB405				
ISE 5005	系統分析	System Analysis	選	3	3	傅鶴齡 PT703					IJK EE324	
ISR 5110	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

教室棟別代碼：

EE—工程五館、EF—工程六館、MB—管理二館